PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-076698

(43) Date of publication of application: 14.03.2000

(51)Int.CI.

G11B 7/14

(21)Application number: 10-241883

(71)Applicant:

HITACHI MEDIA ELECTORONICS CO

LTD

(22)Date of filing:

27.08.1998

(72)Inventor:

SUGI YASUYUKI **OKUDA TADASHI**

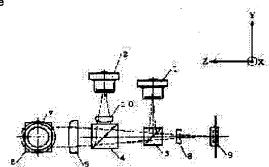
FUJITA SHINJI OTA MITSUHIKO SUGIYAMA TOSHIO

(54) OPTICAL HEAD AND OPTICAL DISK DEVICE USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an optical head which has a simple adjusting mechanism causing little misalignment in the position of a light source after adjustment, and is excellent in reliability.

SOLUTION: This is an optical head comprising a 1st light source 1, a 2nd light source, an optical multiplexer 4 for synthesizing a 1st light bean from the 1st light source 1 and a 2bd light beam from the 2nd light source 2, a light converging means 7 for converging the 1st light beam and the 2nd light beam on an optical disk, and a photo-detector 9 for receiving the light reflected from the optical disk of the 1st light beam 1 and the 2nd light beam. In this case, an optical element 10 having a lens action to change an divergence angle of the 2nd light beam is arranged between the optical multiplexer 4 and the 2nd light source 2.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

G11B 7/14

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-76698 (P2000-76698A)

(43)公開日 平成12年3月14日(2000.3.14)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

G11B 7/14

テーマコート*(参考)

5D119

審査請求 未請求 請求項の数15 OL (全 10 頁)

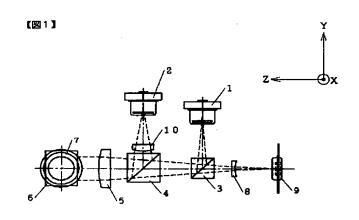
	·	<u> </u>	
(21)出願番号	特顯平10-241883	(71)出願人	000153535
			株式会社日立メディアエレクトロニクス
(22)出顧日	平成10年8月27日(1998.8.27)		岩手県水沢市真城字北野1番地
-		(72)発明者	杉 靖幸
			岩手県水沢市真城字北野1番地 株式会社
			日立メディアエレクトロニクス内
		(72)発明者	奥田 正
		(10/)09/16	岩手県水沢市真城字北野1番地 株式会社
			日立メディアエレクトロニクス内
		(74)代理人	
		(74)10壁入	
			弁理士 武 顕次郎
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 光ヘッドおよびそれを用いた光ディスク装置

(57) 【要約】

【課題】 調整機構が簡単で、しかも調整後の光源の位置ずれがほとんどない、信頼性に優れた光ヘッドを提供する。

【解決手段】 第1の光源1と、第2の光源2と、前記第1の光源1からの第1の光ビームと前記第2の光源2からの第2の光ビームとを合成する光合成手段4と、前記第1の光ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる光収束手段7と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光する光検出器9とを有する光ヘッドにおいて、前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子10を前記光合成手段4と第2の光源2の間に配置したことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の光源と、第2の光源と、前記第1 の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第 2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光 ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる 光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの 光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有する 光ヘッドにおいて、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 10 置したことを特徴とする光ヘッド。

【請求項2】 第1の光源と、第2の光源と、前記第1 の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第 2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光 ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる 光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの 光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有する 光ヘッドにおいて、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 20 置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動 させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反 射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とする光 ヘッド。

【請求項3】 第1の光源と、第2の光源と、前記第1 の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第 2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光 ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段 と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収束させる第 2の光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビー ムの光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有 する光ヘッドにおいて、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 置したことを特徴とする光ヘッド。

【請求項4】 第1の光源と、第2の光源と、前記第1 の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第 2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光 ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段 と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収束させる第 2の光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビー ムの光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有 する光ヘッドにおいて、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動 させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反 射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とする光 ヘッド。

【請求項5】 請求項1ないし請求項4記載のいずれか 50 着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段

において、前記第2の光ビームは前記光学素子を通った 後に平行光または略平行光になっていないことを特徴と する光ヘッド。

【請求項6】 光源と、その光源からの光ビームを反射 または透過し光ビームの光ディスクの反射光を透過また は反射する光分離手段と、前記光源からの光ビームを光 ディスク上で収束させる光収束手段と、前記光ビームの 光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有する 光ヘッドにおいて、

前記光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する 光学素子を前記光源と光分離手段の間に配置したことを 特徴とする光ヘッド。

【請求項7】 光源と、その光源からの光ビームを反射 または透過し光ビームの光ディスクからの反射光を透過 または反射する光分離手段と、前記光源からの光ビーム を光ディスク上で収束させる光収束手段と、前記光ビー ムの光ディスクからの反射光を受光する光検出器とを有 する光ヘッドにおいて、

前記光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する 光学素子を前記光源と光分離手段の間に配置し、その光 学素子を光ビームの光軸方向に移動させることにより光 ビームの光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集 光させることを特徴とする光ヘッド。

【請求項8】 請求項6または請求項7記載において、 前記光ビームは前記光学素子を通った後に平行光または 略平行光になっていないことを特徴とする光ヘッド。

【請求項9】 請求項1ないし請求項8記載のいずれか において、前記光学素子に回折格子が形成されているこ とを特徴とする光ヘッド。

【請求項10】 第1の光源と、第2の光源と、前記第 1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの 第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の 光ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させ る光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビーム の光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着 された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段 と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1 の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電 源制御手段を備えた光ディスク装置において、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 置したことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項11】 第1の光源と、第2の光源と、前記第 1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの 第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の 光ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段 と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収束させる第 2の光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビー ムの光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装

と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段と、前記第1の光収束手段または第2の光収束手段のいずれか一方を光ビームの光路内に入れる移動制御手段を備えた光ディスク装置において、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を 有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 置したことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項12】 第1の光源と、第2の光源と、前記第 1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの 10 第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の 光ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビーム の光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1 の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段を備えた光ディスク装置において、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配 20 置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項13】 第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収束させる第2の光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段と、前記第1の光収束手段または第2の光収束手段のいずれか一方を光ビームの光路内に入れる移動制御手段を備えた光ディスク装置において、

前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動 40 させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とする光ディスク装置。

【請求項14】 請求項10ないし請求項13記載のいずれかにおいて、前記第2の光ビームは前記光学素子を通った後に平行光または略平行光になっていないことを特徴とする光ディスク装置。

【請求項15】 請求項10ないし請求項14記載のいずれかにおいて、前記光学素子に回折格子が形成されていることを特徴とする光ディスク装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高密度記録または 再生用ディスクやCD (Compact Disc)などの光ディス クへの情報の書込みや読出しを行なう光ヘッドおよびそ れを用いた光ディスク装置に関する。

[0002]

【従来の技術】図7に示す従来の光ヘッドは、第1の光 ビームの光ディスクから反射光と、第2の光ビームの光 ディスクから反射光を同一の光検出器で受光している。

【0003】同図において図中の100は光ディスク、101は半導体レーザー、102は半導体レーザー、103は波長偏光フィルター、104は集光レンズ、105は光ビーム、106は波長偏光フィルター、107は波長板、108は対物レンズ、109は検出レンス、110は光検出器である。

【0004】この光ヘッドにおいて、前記半導体レーザー101は第1の光ディスクを再生するための第1の波長(波長635nm)を有し、前記半導体レーザー102は第2の光ディスクを再生するための第2の波長(波長780nm)を有している。

【0005】この光ヘッドの組立時、半導体レーザー101から出射された第1の光ビームが光検出器110で受光されて、光検出器110から所定の信号が出力されるように、すなわち正しく集光するように半導体レーザー102以外の各部品の位置関係が調整される。その後、半導体レーザー102から出射された第2の光ビームも光検出器110で受光されて、光検出器110から所定の信号が出力されるように、半導体レーザー102以外の各部品の位置関係が調整される。

【0006】しかし後者の位置調整の際、先に調整した第1の光ビームでの光検出器110の適正な集光状態が崩れることがある。この弊害を解消するため、半導体レーザー102を移動して第2の光ビームが光検出器110に適正な集光されるように調整していたが、この調整は半導体レーザー102を第2の光ビームの光軸に垂直で、互いに直交する2軸方向に移動させ、また第2の光ビームの光軸に平行な方向にも移動させて調整していた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】このように従来の光へッドは半導体レーザー102を3軸方向に移動させて調整していたので、調整機構が複雑である。また調整完了後に半導体レーザー102をヘッドケースなどに固定するのに接着剤などを使用すると、各種環境試験などで半導体レーザー102の位置がずれて第2の光ビームが光検出器110に適正な集光されないなどの欠点を有している。

【0008】本発明の目的は、このような従来技術の欠 50 点を解消し、調整機構が簡単で、しかも調整後の光源の

位置ずれがほとんどない、信頼性に優れた光ヘッドおよ びそれを用いた光ディスク装置を提供するにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、第1の本発明は、例えば第1の半導体レーザーなど の第1の光源と、例えば第2の半導体レーザーなどの第 2の光源と、前記第1の光源からの第1の光ビームと前 記第2の光源からの第2の光ビームとを合成する例えば ダイクロプリズムなどの光合成手段と、前記第1の光ビ ームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる例 えば対物レンズなどの光収束手段と、前記第1の光ビー ムと第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光す る光検出器とを有する光ヘッドを対象とするものであ る。

【0010】そして前記第2の光ビームの発散角を変化 させるレンズ作用を有する例えばレンズなどの光学素子 を前記光合成手段と第2の光源の間に配置したことを特 徴とするものである。

【0011】前記目的を達成するため、第2の本発明 は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源から の第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビー ムとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームと第 2の光ビームとを光ディスク上で収束させる光収束手段 と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスク からの反射光を受光する光検出器とを有する光ヘッドを 対象とするものである。

【0012】そして前記第2の光ビームの発散角を変化 させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と 第2の光源の間に配置し、その光学素子を第2の光ビー ムの光軸方向に移動させることにより第2の光ビームの 30 光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させる ことを特徴とするものである。

【0013】前記目的を達成するため、第3の本発明 は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源から の第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビー ムとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームを光 ディスク上で収束させる例えば対物レンズなどの第1の 光収束手段と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収 束させる例えば対物レンズなどの第2の光収束手段と、 前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスクから の反射光を受光する光検出器とを有する光ヘッドを対象 とするものである。

【0014】そして前記第2の光ビームの発散角を変化 させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と 第2の光源の間に配置したことを特徴とするものであ る。

【0015】前記目的を達成するため、第4の本発明 は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源から の第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビー ムとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームを光 50 第2の光源の間に配置したことを特徴とするものであ

ディスク上で収束させる第1の光収束手段と、前記第2 の光ビームを光ディスク上で収束させる第2の光収束手 段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディス クからの反射光を受光する光検出器とを有する光ヘッド を対象とするものである。

6

【0016】そして前記第2の光ビームの発散角を変化 させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と 第2の光源の間に配置し、その光学素子を第2の光ビー ムの光軸方向に移動させることにより第2の光ビームの 光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させる ことを特徴とするものである。

【0017】前記目的を達成するため、第5の本発明 は、例えば半導体レーザーなどの光源と、その光源から の光ビームを反射または透過し光ビームの光ディスクの 反射光を透過または反射する例えばハーフミラーなどの 光分離手段と、前記光源からの光ビームを光ディスク上 で収束させる光収束手段と、前記光ビームの光ディスク からの反射光を受光する光検出器とを有する光ヘッドを 対象とするものである。

【0018】そして前記光ビームの発散角を変化させる レンズ作用を有する光学素子を前記光源と光分離手段の 間に配置したことを特徴とするものである。

【0019】前記目的を達成するため、第6の本発明 は、光源と、その光源からの光ビームを反射または透過 し光ビームの光ディスクからの反射光を透過または反射 する光分離手段と、前記光源からの光ビームを光ディス ク上で収束させる光収束手段と、前記光ビームの光ディ スクからの反射光を受光する光検出器とを有する光ヘッ ドを対象とするものである。

【0020】そして前記光ビームの発散角を変化させる レンズ作用を有する光学素子を前記光源と光分離手段の 間に配置し、その光学素子を光ビームの光軸方向に移動 させることにより光ビームの光ディスクからの反射光を 前記光検出器上に集光させることを特徴とするものであ る。

【0021】前記目的を達成するため、第7の本発明 は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源から の第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビー ムとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームと第 2の光ビームとを光ディスク上で収束させる光収束手段 と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスク からの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディ スクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディス ク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の 光源の動作または非動作を切り替える例えばシステム制 御回路から構成される電源制御手段を備えた光ディスク 装置を対象とするものである。

【0022】そして前記第2の光ビームの発散角を変化 させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と

-4-

40

る。

【0023】前記目的を達成するため、第8の本発明は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段と、前記第1の光ビームを光ディスク上で収束させる第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段と、前記第1の光収束手段または第2の光収束手段のいずれか一方を光ビームの光路内に入れる例えばシステム制御回路とアクチュエーター駆動回路から構成される移動制御手段を備えた光ディスク装置を対象とするものである。

【0024】そして前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配置したことを特徴とするものである。

【0025】前記目的を達成するため、第9の本発明は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームとを光ディスク上で収束させる光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段を備えた光ディスク装置を対象とするものである。

【0026】そして前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とするものである。

【0027】前記目的を達成するため、第10の本発明は、第1の光源と、第2の光源と、前記第1の光源からの第1の光ビームと前記第2の光源からの第2の光ビームとを合成する光合成手段と、前記第1の光ビームを光ディスク上で収束させる第1の光収束手段と、前記第2の光ビームを光ディスク上で収束させる第2の光収束手段と、前記第1の光ビームと第2の光ビームの光ディスクからの反射光を受光する光検出器と、装着された光ディスクの種類を判別するディスク判別手段と、そのディスク判別手段の判別結果に基づき前記第1の光源と第2の光源の動作または非動作を切り替える電源制御手段と、前記第1の光収束手段のい

ずれか一方を光ビームの光路内に入れる移動制御手段を 備えた光ディスク装置を対象とするものである。

【0028】そして前記第2の光ビームの発散角を変化させるレンズ作用を有する光学素子を前記光合成手段と第2の光源の間に配置し、その光学素子を第2の光ビームの光軸方向に移動させることにより第2の光ビームの光ディスクからの反射光を前記光検出器上に集光させることを特徴とするものである。

[0029]

【発明の実施の形態】本発明は前述のような構成になっており、第2の光源を第2の光ビームの光軸に垂直で互いに直交する2軸方向にのみ移動させて、その位置調整を行なうことができる。そのため調整機構が簡単で、しかも第2の光源をヘッドケースなどに当接して固定することができるから、光源の位置調整後に固定して各種環境試験などを行なっても光源の位置ずれなどを生じることがほとんどなく、そのために信頼性の高い光ヘッドおよびそれを用いた光ディスク装置を提供することができる。

【0030】次に本発明の実施の形態を図とともに説明する。図1は、第1の実施の形態に係る光ヘッドの概略構成図である。第1の半導体レーザー1からは波長650nmの第1の光ビームを出射し、第2の半導体レーザー2からは波長780nmの第2の光ビームを出射するようになっている。

【0031】前記第1の半導体レーザー1から出射された第1の光ビームはプリズム3により反射し、ダイクロプリズム4を通り、コリメートレンズ5に到着する。コリメートレンズ5により集光されて平行光となり全反射ミラー6により反射し、対物レンズ7で集光されて基板厚さが0.6mmの光ディスク(図示せず)の記録面上に光スポットを形成する。

【0032】そして第1の光ビームはその記録面で反射し、対物レンズ7を通り全反射ミラー6で反射し、コリメートレンズ5、ダイクロプリズム4、プリズム3を順次通り、検出レンズ8に到達する。検出レンズ8は片方の面がシリンドリカル面、他方の面が凹球面のレンズとなっており、第1の光ビームは検出レンズ8のシリンドリカル面により非点収差を与えられて、光検出器9に到達する。

【0033】この第1の光ビームにより基板厚0.6mmの光ディスクの情報を再生する場合、フォーカスは非点収差法、トラッキングは位相差法によって行なう。ここで第1の光ビーム(波長650nm)が光検出器9で受光されて、光検出器9から所定の信号が出力されるように、すなわち適正に集光するように、各部品の位置関係が調整される。この第1の実施の形態では、光検出器9を図1の紙面に沿って上下方向(Y方向)と図1の紙面に対して垂直方向(X方向)に移動して位置調整するとともに、検出レンズ8を図1の紙面に沿って左右方向

(2方向) に移動して位置調整する。

【0034】次に前記第2の半導体レーザー2から出射された第2の光ビームはレンズ10を通り、ダイクロプリズム4で反射し、コリメートレンズ5に到着する。レンズ10は平凸レンズで、片側の平面に直線回折格子が刻んであって、それにより3スポット法トラツキングのための3ビーム(0次光、+1次光、-1次光)を形成する。レンズ10の他方の面は凸球面となっており、それによりレンズ10を通った後の光ビームはレンズ10に入射する光ビームに比べて弱い発散光となっており、平行光または略平行光になっていない。

【0035】第2の光ビームはコリメートレンズ5により集光されて平行光となり全反射ミラー6により反射し、対物レンズ7で集光されて基板厚さが1.2mmの光ディスク(図示せず)の記録面上に光スポットを形成する。

【0036】そして第2の光ビームはその記録面で反射し、対物レンズ7を通り全反射ミラー6で反射し、コリメートレンズ5、ダイクロプリズム4、プリズム3を順次通り、検出レンズ8に到達する。そして第2の光ビー 20ムは検出レンズ8のシリンドリカル面により非点収差を与えられて、光検出器9に到達する。

【0037】この第2の光ビームにより基板厚1.2mmの光ディスクの情報を再生する場合、フォーカスは非点収差法、トラッキングは3スポット法によって行なう。なお、対物レンズ7は波長650nmの第1の光ビームで基板厚0.6mmの所謂DVDなどの光ディスクの記録面に良好な光スポットを形成し、さらに波長780nmの第2の光ビームで基板厚1.2mmの所謂CDなどの光ディスクの記録面に良好な光スポットが形成できる対物レンズである。

【0038】ここで第2の光ビーム(波長780nm) が光検出器9で受光されて、光検出器9から所定の信号 が出力されるように、すなわち適正に集光するように、 各部品の位置関係が調整される。第2の半導体レーザー 2とレンズ10以外の図1に示す部品を移動させて調整 すると、既に調整済みである第1の光ビームの集光状態 がずれるので、第2の光ビームのみが通っている部分、 すなわち第2の半導体レーザー2またはレンズ10もし くは両方を移動させて第2の光ビームの集光状態を調整 40 する。この調整は、図1に示すX、Y、Zの3方向につ いて行なう必要があり、この第1の実施の形態では第2 の半導体レーザー2をX方向とZ方向に移動して調整 し、レンズ10をY方向に移動して調整する。またレン ズ10は3スポット用の直線回折格子が形成されている ので、図1のY軸まわりに回転させて光ディスク上に適 正に0次光と+1次光と-1次光の光スポットを配置す るように調整する。

【0039】このようにすれば半導体レーザー2についてはX方向とZ方向の2軸調整で良いので、図2に示す 50

10

ようにヘッドケース11に半導体レーザー2を当接して 安定に固定することが可能である。なお、半導体レーザー2はヘッドケース11に対して図1に示すX方向と Z 方向に移動する必要があるので、ヘッドケース11に対 するの半導体レーザー2の当接部12が小さくなる場合 がある。そのような場合には図3に示すように半導体レーザー2をホルダー13に固定し、ホルダー13がヘッドケース14に対して移動可能になっておれば、半導体レーザー2とホルダー13の当接部15を大きくすることができ、半導体レーザー2が安定して取り付けることができる。

【0040】図2や図3のような固定構造を採用すれば、半導体レーザー2の位置調整終了後に直接またはホルダーを介してヘッドケースに当接させて固定できるので、各種環境試験時に半導体レーザー2の位置ずれが生じないかあるいは生じ難くすることができる。

【0041】本実施の形態ではレンズ10の平面側に回 折格子が形成されているが、もともと3スポット法でト ラッキングする場合には回折格子は必要で、従来は両面 とも平面のガラスまたはプラスチックの平行平面板の片 方の面に回折格子を刻んでいた。本実施の形態ではレン ズ10の平面側に回折格子を形成し、他方の面は球面形 状にしてレンズ作用を持たせて、レンズ10を光ビーム の光軸方向に移動させることにより、光検出器上での光 ビームの集光状態が調整できるから、特別にレンズ1枚 を追加する必要はない。

【0042】本実施の形態では、レンズ10を第2の半導体レーザー2とダイクロプリズム4との間に配置したが、第1の半導体レーザー1とプリズム3の間に配置することも可能である。その場合には回折格子を半導体レーザー2とダイクロプリズム4の間に配置して、第2の光ビームの位置調整は検出レンズ8と光検出器9を移動させて行ない、第1の光ビームの位置調整は第1の半導体レーザー1をX、Z方向に移動させ、半導体レーザー1とプリズム3の間に配置したレンズ10をY方向に移動させて調整を行なう。

【0043】本実施の形態ではプリズム3を用いたが、 その代わりに平行平面板のハーフミラーを使用すること もできる。

【0044】本実施の形態では、レンズ10を光軸方向に移動させて第2の光ビームの光検出器9上での集光状態を調整したが、レンズ10を第2の光ビームの光路内に入れているので、光ディスクの記録面上での光スポットの収差を変えることも可能である。特にレンズ10のY方向の位置調整することにより、球面収差を変えることができる。また前記収差の値を変えないようにしたい場合には、レンズ10を非球面形状にすることも有効である。

【0045】本実施の形態では、半導体レーザー2を図 1のX、Z方向に移動して調整すればよいので、半導体 レーザー2を直接またはホルダーを介してヘッドケース に当接させることができ、各種環境試験時に半導体レー ザー2の位置ずれが生じないかあるいは生じ難くすると いう効果がある。

【0046】本実施の形態では、同一の対物レンズ7で 異なる波長の光ビームで異なる基板厚の光ディスクを再 生する場合を説明したが、異なる対物レンズで再生する 場合も本発明は有効である。そのことにつき第2の実施 の形態として図4とともに説明する。

【0047】第2の実施の形態において前記第1の実施 10 の形態と相違する点は、対物レンズの部分が異なるのみである。図4(a)は、基板厚0.6mmの光ディスクを再生する場合を示しており、波長650nmの第1の光ビームが対物レンズ17により光ディスクの記録面上に良好な光スポットを形成し、その反射光が光検出器9に集光される。図4(b)は、基板厚1.2mmの光ディスクを再生する場合を示しており、波長780nmの第2の光ビームが対物レンズ16により光ディスクの記録面上に良好な光スポットを形成し、その反射光が光検出器9に集光される。そして図4(b)において、第2 20 の半導体レーザー2をX、Z方向に移動させ、レンズ10をY方向に移動させて調整を行なうのは前記第1の実施の形態と同じである。

【0048】次に第3の実施の形態について図5とともに説明する。半導体レーザー21から出射された波長780nmの光ビームはレンズ22を通り、ハーフミラー23により反射し、全反射ミラー24により反射して、対物レンズ25で集光されて基板厚さが1.2mmの光ディスク(図示せず)の記録面上に光スポットを形成する。

【0049】そして光ビームはその記録面で反射し、対物レンズ7を通り全反射ミラー24で反射し、ハーフミラー23を通り、光検出器9に到達する。

【0050】フォーカスは非点収差法、トラッキングは3スポット法よって行なう。非点収差法のための非点収差はハーフミラー23により与えられ、3スポット法のための3ビームはレンズ22の平面側に刻まれた回折格子によって作られる。

【0051】光ビーム(波長780nm)が光検出器9で受光されて、光検出器9から所定の信号が出力されるように、すなわち適正に集光するように、各部品の位置関係を調整するには、光検出器26を図5に示すX、Y方向に移動させ、レンズ22をY方向に移動させ、レンズ22をY方向に移動して位置調整を行なう。

【0052】図5に示すような所謂CD用光ヘッドにおいては、従来は図5のレンズ22の代わりに3スポット用の平行平面形状の回折格子が設けられて、光検出器9をX、Y方向に移動させ、半導体レーザー21をY方向に移動させ調整するものや、レンズ22の代わりに3ス 50

12

ポット用の平行平面形状の回折格子があり、さらにハーフミラー23と光検出器26との間に検出レンズを設け、光検出器26をX、Y方向に移動させ、検出レンズを2方向に移動させて調整するものがあった。本実施の形態では第1の実施の形態でも述べたように、従来の3スポット用の回折格子の片方の面を球面としてピント調整用のレンズ22としているので、レンズを特別に追加する必要はない。

【0053】本実施の形態では、レンズ22を光軸方向に移動させて光ビームの光検出器26上での集光状態を調整すると述べたが、レンズ22を光ビームの光路内に入れているので、光ディスク上での光スポットの収差を変えることも可能である。特にレンズ22をY方向に沿って位置調整することにより、球面収差の値を変えることができる。また前記収差を変えないようにしたい場合は、レンズ22を非球面形状にすることも有効である。【0054】本実施の形態では、ハーフミラー23と光検出器26との間に検出レンズが不要で、また半導体レーザー21をY方向に移動させ調整する必要がないという効果がある。

【0055】次に図6を用いて本発明の光ディスク装置のシステム全体について説明する。光ヘッドの光学系としては図1に示したものを用いている。よってこの光ディスク装置は基板厚0.6mmの高密度光ディスクと基板厚1.2mmのCDやCD-R用の光ディスクを記録または再生する装置である。

【0056】まず光ディスクが光ディスク装置に装着されるとディスク判別手段30が機能し、装着された光ディスクの基板厚などの種類を判別し、その結果をシステム制御回路31に出力する。前記ディスク判別手段30で光ディスクの種類を判別する方法としては、光ディスクの基板の厚さを光学的もしくは機械的な手段で検出する方法、光ディスクまたはそれを収納するカートリッジに予め記録された例えばマークなどの識別情報を検出する方法、光ディスクの種類を仮定してディスク信号を再生し、正常な信号が得られなければ別の種類の光ディスクであると判別する方法などがある。

【0057】基板厚0.6mmの高密度光ディスクと判断した場合、システム制御回路31からレーザー駆動回路A32に信号が出力され、半導体レーザー1から光ビームが発し、図1と同様にして光検出器9に第1の光ビームが入射する。光検出器9では第1の光ビームが入射すると信号が発生し、信号処理回路33へ送られる。信号処理回路33では送られてきた信号の増幅、フォーカスエラー信号の生成、トラッキングエラー信号の生成、再生信号の生成などが行なわれ、システム制御回路31に送られる。前記フォーカスエラー信号とトラッキングエラー信号からアクチュエーターを駆動する必要があるかどうかをシステム制御回路31が判断し、必要があるときにはアクチュエーター駆動回路34を経由してアク

チュエーターが駆動され、対物レンズ7をフォーカス方 向またはトラッキング方向に移動する。また再生信号は 光ディスク装置の出力端子へ送られる。

【0058】前記ディスク判別手段30で基板厚1.2 mmの光ディスクと判断した場合、システム制御回路3 1からレーザー駆動回路B35に信号が出力され、半導 体レーザー2から第2の光ビームが発し、図1と同様に して光検出器9に第2の光ビームが入射する。光検出器 9ではフォーカスエラー信号、トラッキングエラー信 号、再生信号などが生成され信号処理回路33へ送られ 10 る。信号処理回路33では送られてきた信号の増幅が行 なわれ、システム制御回路31に送られる。前記フォー カスエラー信号とトラッキングエラー信号からアクチュ エーターを駆動する必要があるかどうかをシステム制御 回路31が判断し、必要があるときにはアクチュエータ 一駆動回路34を経由してアクチュエーターが駆動さ れ、対物レンズ7をフォーカス方向またはトラッキング 方向に移動する。また再生信号は光ディスク装置の出力 端子へ送られる。

[0059]

【発明の効果】本発明は前述のような構成になっており、第2の光源を第2の光ビームの光軸に垂直で互いに直交する2軸方向にのみ移動させて、その位置調整を行なうことができる。そのため調整機構が簡単で、しかも第2の光源をヘッドケースなどに当接して固定することができるから、光源の位置調整後に固定して各種環境試験などを行なっても光源の位置ずれなどを生じることがほとんどなく、そのために信頼性の高い光ヘッドおよびそれを用いた光ディスク装置を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態に係る光ヘッドの概略構成図である。

【図2】その光ヘッドにおける半導体レーザーの固定構

造を示す図である。

【図3】半導体レーザーの他の固定構造を示す図である。

14

【図4】本発明の第2の実施の形態に係る光ヘッドの概略構成図である。

【図5】本発明の第3の実施の形態に係る光ヘッドの概略構成図である。

【図6】本発明の光ディスク装置のシステム構成図である。

10 【図7】従来提案された光ヘッドの概略構成図である。 【符号の説明】

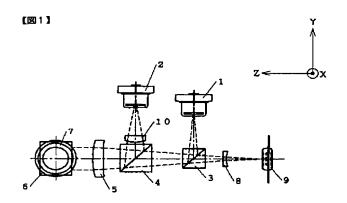
- 1 第1の半導体レーザー
 - 2 第2の半導体レーザー
 - 3 プリズム
- 4 ダイクロプリズム
- 5 コリメートレンズ
- 6、24 全反射ミラー
- 7、16、17、25 対物レンズ
- 8 検出レンズ
- 20 9 光検出器
 - 10 レンズ
 - 11、14 ヘッドケース
 - 12、15 当接部
 - 13 ホルダー
 - 21 半導体レーザー
 - 22 レンズ
 - 23 ハーフミラー
 - 30 ディスク判別手段
 - 31 システム制御回路
- 30 32 レーザー駆動回路A
 - 33 信号処理回路
 - 34 アクチュエーター駆動回路

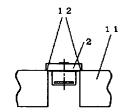
【図2】

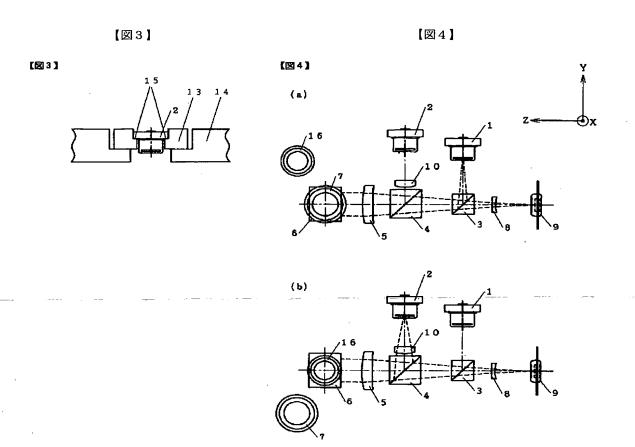
35 レーザー駆動回路B

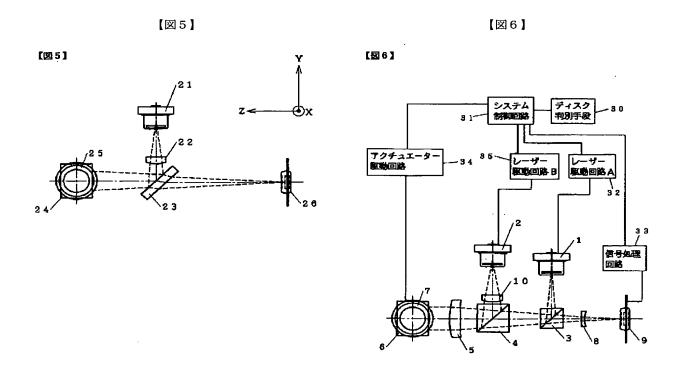
【図1】

【図2】



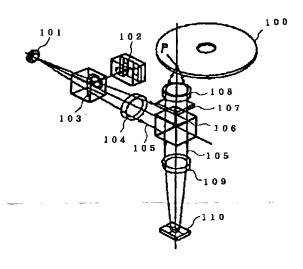






【図7】

【図7】



フロントページの続き

(72) 発明者 藤田 真治

岩手県水沢市真城字北野1番地 株式会社 日立メディアエレクトロニクス内

(72)発明者 太田 光彦

岩手県水沢市真城字北野1番地 株式会社 日立メディアエレクトロニクス内 (72) 発明者 杉山 俊夫

岩手県水沢市真城字北野1番地 株式会社 日立メディアエレクトロニクス内

Fターム(参考) 5D119 AA36 AA38 BA01 BB11 EC35 EC40 FA08 JA27